

大森素形材工学研究室
Materials Fabrication Laboratory

主任研究員 大森 整 (工博)
OHMORI, Hitoshi (Dr. Eng.)



キーセンテンス：

1. マイクロ構造 / 機能素子のためのナノメカニカルファブリケーション研究
2. ELID (電解インプロセスドレッシング) 研削法の研究
3. 超平滑加工の研究
4. ナノプレジジョン・マイクロメカニカルファブリケーションの研究
5. 超精緻成形加工の応用とコンピュータシミュレーション研究
6. マイクロファブリケーションの応用研究
7. トライボファブリケーション研究

キーワード：

ELID (電解インプロセスドレッシング) 研削, ナノプレジジョン・マイクロメカニカルファブリケーション技術, 環境調和 ELID 加工技術, 超平滑加工, トライボファブリケーション, デスクトップ加工システム, 表面改質加工, 先端光学素子加工, 超精緻成形加工, コンピュータ援用加工, フィードバック加工プロセス, スーパーアナライザーテクノロジー

研究概要

素材に機能と形状を付与することは、"物づくり"の基本です。工業材料の主役である金属材料やプラスチック材料はもとより、電子材料、光学材料、セラミックス、複合材料などの分野で、加工困難な新素材が次々と登場し、また先進の高機能デバイスの開発においては、加工精度の超精密化、サイズの超微細化、形状の多自由度化、加工表面の高機能化等に対する要求が高まり、素形材工学の重要性は増大の一途をたっています。当研究室では、素形材工学にブレークスルーをもたらす革新的な新加工技術、超加工技術の研究開発を行うとともに、その応用研究と実用システムの開発を進めています。当研究室で開発したELID(電解インプロセスドレッシング)研削法の実用化の進展に伴い、光、電子、新素材、自動車、バイオ・医用、金型・工具・機械分野などの、さまざまな生産分野で多くの新しい成果を挙げています。また、超精密、ナノプレジジョン加工システムの研究開発、表面改質加工法およびナノレベルの超平滑加工法の研究開発を通して、微細表面構造および表面機能を創成するマイクロメカニカルファブリケーションの研究領域へと展開を進め、最先端科学を支えるナノ光学素子や天文光学素子、そしてセンサー、マイクロツール開発、さらに次世代の微細光学機器や環境・エネルギーを支える太陽光オプティカルシステム、先進電子デバイスの研究開発などへと波及し、基礎科学研究から産業界への応用までブレークスルーをもたらしつつあります。

1. マイクロ構造/機能素子のためのナノメカニカルファブリケーション研究

(1) ELID加工法の研究(大森,片平,小野*1,八須*2,春日*2,水谷*3,高橋*4,成瀬*5,上原*5,林*5,梅津*5,小茂鳥*5,粟木*5,丸山*5,山本*5,小川*5,貝瀬*5,出口*5,小松*5,康*5,吉川*5,大森(宮)*5,松澤*5,宮澤*5,三好*5,中川*5,野口*5,鈴木(和)*5,高田*5,横山*5,上野*5,清水*5,進藤*5,島崎*5,小谷*6,米山*6,吉田*6,根本*7,陳*8,金*9,三島*10)

ELID法の制御, および同手法の適用範囲の拡充, ナノプレジジョンELID研削のためのシステム開発などについて系統的な研究を進めた. 具体的研究成果として, オプティカルガラス素材に対して, 材料特性と加工表面精度の関係を見出し, 基底パラメータを用いた条件探索方法を適用して, 有効な条件を見出した. また, 次世代高出力マイクロチップレーザーの高精度加工法として, ELID研削の適用を引き続き行い, 薄型曲面形状の超精密加工実験に成功した. このアクティビティは, エクストリームフォトンクス研究と連携を取りながら進めている. また, LED基板材料としてニーズの高まるサファイヤ基板のナノ表面加工を目指して, ELIDD研削法の適用を進めている. 加工面の平滑化を目指し, 弾性砥石にELID研削法を適用した導電性ラバーボンド砥石を改良して, より高品位な平滑面を実現できることを確認した. 一方, ELID法

の応用展開として、加工と同時に被加工物表面に微細な改質層を形成、新しい機能を付加する複合プロセスを進展させた。特に、Co-Cr合金からなるMOM(Metal on Metal)式人工股関節の加工実験を進め、その精度の評価とともに、表面特性についての評価も進めている。一連のELIDプロセスの研究活動は、関連する学協会や研究会とともに国内のコミュニティ形成を一層推進するとともに、その活動の国際化を引き続き進め、国際会議を台湾磨粒加工学会と連携して、国立台湾大学、金属工業研究発展中などと開催した。ELID技術情報発信と議論を目的としたセミナーやシンポジウム、見学会などを積極的に主催するとともに、ELIDシステムの標準化に向けたテンプレートの開発にも着手した。さらに、米国、中国や独国の研究機関や大学から研究者を招くなど研究交流の強化を図ると共に、コア技術の積極的アピールに努めるなど、研究コミュニティの一層のグローバル化を推し進めた。

(2) 超平滑加工の研究(大森, 片平, 小野*1, 春日*2, 上原*5, 河西*5, 池野*5, 土肥*5, 長谷川*5, 堀尾*5, 伊藤(伸)*5, 小仲*5, 増田*5, 松澤*5, 山内*5, 三村*5, 水谷*2, 村上*5, 八須*2, 永倉*5, 大前*5, 林*5, 根本*7)

超平滑加工を必要とする半導体材料、光学素子材料、生体材料、機構部品に対して、ナノレベルからサブナノレベルの極限平滑面を創成するメカニカル/ケミカル加工法の継続研究とこれに高い形状精度を付加させるスーパーポリシング手法の検討を行った。次世代デバイス用単結晶SiC, GaN, サファイヤなどの高精度・高能率加工として、ELID/CMP連携加工の基礎研究として推進した。また、ELID法を援用した半導体デバイス加工を目指し、カーボンボンド砥石の開発に端を発した砥石ボンド材の検討に伴い、環境を配慮した砥石、植物由来の素材を利用したカーボン砥石の開発を進めた。ナノダイヤモンドコロイドによる高品位ポリシング実験から、トライポファブ리케이션という新しい研究分野を開拓し、続いてナノダイヤモンド含有砥石ボンド材の開発および特性調査を進めている。また、ELID/研磨の連携加工プロセスに関して、前年度に引き続きELID研削法と遊離砥粒による研磨や磁性流体研磨(MRF)法を連携させた加工プロセス技術の研究を行い、X線分析用のミラーの加工の検証を行っている。これらのアクティビティは、関連する学協会およびエクストリームフォトンクス研究と連携を取りながら推進している。一方、シンガポールの研究者とは引き続き、ELIDと電気泳動研磨との連携についても調査を行っている。さらに連携加工プロセスの応用として、ELID/研磨/EEM加工プロセス構築を進め、国家基幹研究であるX線自由電子レーザー(XFEL)建設に必要な長尺高精度なXFELミラーの開発として、ユーザビリティを考慮した設計思想に基づき、石英製の長尺XFELミラーの製作を行った。このアクティビティは、スーパー・アナライザー開発テクノロジー研究と連携して推進している。これらの成果の一部は、スーパー・アナライザーシンポジウムを通して情報発信および意見交換を行っている。また、英国Cranfield大学との合同会議を通して、ELIDおよびナノ加工の連携研究推進に着手した。

(3) 超微細加工の研究(大森, 和田, 片平, 八須*2, 春日*2, 高橋*4, 上原*5, 成瀬*5, 林*5, 武安*5, 安藤*5, 藤井*5, 部谷*5, 吹春*5, 船田*5, 古林*5, 後藤*5, 石井*5, 石坂*5, 伊藤*5, Jabri*5, 上村*5, 加藤*5, 近藤*5, 松下*5, 増田(忠)*5, 三浦*5, 白滝*5, 鳥居*5, 常木*5, 袁*5, 鈴村*6, 安藤(文)*6, 北村*6, 渡辺*6, 吉田*6)

マイクロメカニカルファブ리케이션の加工手法の研究において、シャープエッジを用いたツールによる安定した加工が重要であり、トライポファブ리케이션のアクティビティと連携して、長寿命ツールの開発に取り組んだ。また、ツール材料としてPCD(Polycrystalline Diamond)に対して、ツルージング手法にマイクロ放電加工を適用後、ELIDの適用を試みた。そして、回折・分散光学素子や微細ノズルなど微細加工プロセスの構築を継続して進めた。回折・分散光学素子としては、数百nm以下の特殊構造の加工に精工した。ステアケース型レーザー回折素子に対しては、マイクロELID法を適用して、石英に対して超精密な加工を実施することができた。また、デスクトップマシン開発として、人工股関節骨頭等の微細加工に対応できるシステム構築を進め、新しいイオンショット法により、その手法の実用化を目指し研究を進めている。また、アクリル材に対してマイクロノズル加工を行い、マイクロファブ리케이션の応用研究のアクティビティと連携して、PELID法のマイクロノズル部の形成を進めた。一方、全空気静圧型非接触駆動装置にリニアモータ駆動方式を採用した装置において、微量のナノカーボンとELID加工液を用いたイオンショットクーラントシステムを新たに開発し、それにより鉄系素材のダイヤモンド切削加工を行い、ツール摩耗が極端に抑えられるという世界初の新規の知見に基づいて、加工メカニズムの解析実験を

進めた。このアクティビティは、スーパー・アナライザー開発テクノロジー研究推進グループと一定の連携を保ちながら研究を進めている。一連の研究活動は、関連する学協会、研究会、およびMIRAI Instituteとともに交流を推進し、第4回国際MIRAI会議（第10回国際マイクロファブリケーション会議）を合同開催した。また、マイクロ加工におけるデータ収集・体系化手法の研究、およびこれらの統合化に必要なプラットフォームシステムの構築を引き続き進めた。具体的には、加工プロセスカルテや先進加工データベースとの連携プラットフォームを考案して、その基本開発を推進し、関係する学協会、研究会との意見交換を進め、研究を進めている。

2. 超精緻成形加工の応用とコンピュータシミュレーション研究（大森，鈴木*5，上原*5，斉藤*5，杉本*5，高橋*5，城寶*5，浅原*5，小野(徳)*5，長谷川(太)*5，金井*5，殷*5，青野*5，藤本*5，吉川*5）

材料成形加工に関するシミュレーションプロセスの実用化、および精緻成形プロセス、成形に関わる技能・技術の継承のためのデータ収集手法の開発を目指して研究を進めている。これまでの成果・ノウハウを統合した高精度・高速なシミュレーションソフトウェアを具現化するべく、計算時間が非常に長い板材成形やハイドロフォーミング・シミュレーションソフトの開発・改良を引き続き行った。また、プレス成形テンプレートの改良を行い、作業工程設計の効率化に寄与できる工夫を行った。また、マイクロコンポーネントの量産化を想定して開発したマイクロ金型を用いたマイクロ射出成形手法の検討を、引き続きシミュレーションと連携して進めている。射出成形システムのためのインテグラルシステムの構築として、金型テンプレート化とともに、金型の切削、研削、研磨の各工程間の表面状態を評価し、フィードバックするシステムの構築に必要な手法の検討を進めた。さらに、関係学会、研究会とも交流を図り、研究の推進・ニーズ収集に努めた。

3. マイクロファブリケーションの応用研究（大森，和田，片平，八須*2，前川*2，水谷*3，梅津*5，林*5，上原*5）

先進光学素子開発などを狙い、測定データによるフィードバックシステムの検証を引き続き行い、大口径非球面加工においてシステムの検証を進めている。また、X線ミラーの加工プロセスの検討を行い、大阪大学との連携により、400mmの長尺集光ミラーをナノオーダーの精度で加工し、硬X線による集光試験で長焦点距離（550mm）において、世界的にも類を見ない回折限界集光に成功したELID/EEMとの連携化にかかる知見に基づき、さらなるハイブリッド加工を、東京大学、立教大学などと進めている。特に、ELID/MRFとのハイブリッド化に伴い、さらなる高精度化を目指すアクティビティを進展させた。また、宇宙望遠鏡JEM-EUSOのための1.5m級の両面湾曲型フレネルレンズのマイクロ加工を進め、700nmの回折構造の加工に取り組んだ。このアクティビティは、極限宇宙研究推進グループEUSOチームと連携を取り進めている。一方、伊藤ナノ医工学研究室と共同で三次元の生体組織の作製に関する研究を行い、バイオマテリアルを数 μ mの太さでパターニング可能なことを実証したPELID法を応用して、配線パターニングやコーティングの研究を進めた。一連の研究ニーズの意見交換を含め、関係学協会や研究会とともに交流を推進しており、引き続き、Printed Electronicsに関する第2回JNU-MFL合同ワークショップの開催に至った。高密度プラズマによる表面除去原理の検証や、デスクトップ加工システムにレーザー加工ヘッドを搭載して、微細な表面機能の創成を試みるなど、新たなアプリケーションを探索している。これらの一連の研究成果は、スーパー・アナライザー開発テクノロジー研究推進グループと一定の連携を保ちながら研究を進めている。また、太陽光励起レーザーの研究として、マイクロレンズの開発と、レーザー媒質の開発に着手した。光グリーンテクノロジー特別研究ユニットと連携してレーザーの世代応用に関するシンポジウムを開催して、情報発振とともに情報交換、交流を行い、ニーズに集約を進めている。

4. トライボファブリケーション研究（大森，小野*1，高橋*4，伊藤(伸)*5，林*5，長谷川*5，金澤*5，小林*5，井川*5，松澤*5，根本*7）

トライボロジーと加工および製造プロセスとを繋ぐ境界・融合領域を“トライボファブリケーション”として、ツール加工面の摩擦・摩耗特性と加工現象を学術的に取り扱う研究を遂行している。その結果、工具材質及び要素技術と加工技術とのマッチングが容易になり、新たな加工技術のブレークスルーを生む環境整備に繋がっている。具体的には、光学素子加工用の新しいダイヤモンド工具の開発において、イオンビーム照射による特性を評価することで、開発にかかる知見を得ることができた。また、レンズの表面改質の研究において、ルクセンブルクHenri Tudor研究所との連携により、コーティング処理により新機能を

付与する検討を進めている。なお、一連の情報発信と研究交流については、関係研究会、学協会との連携やトライボコーティングの現状と将来シンポジウムを開催して活発化している。

*1 協力研究員, *2 協力技術員, *3 基礎科学特別研究員, *4 研究嘱託, *5 客員研究員, *6 研修生, *7 ジュニア・リサーチ・アソシエイト, *8 I P A, *9 訪問研究員, *10 客員主管研究員

Key Sentence :

1. Nanoprecision mechanical fabrication processes for micro-structural/functional devices
2. R&D on ELID(Electrolytic In-process Dressing) grinding technology
3. R&D on super smooth surface finishing technology
4. R&D on nanoprecision micro-mechanical fabrication technology
5. Ultrafine transcription and computational mechanics assisted processes
6. Applications on micro-fabrication processes
7. Research on tribo-fabrication technology

Key Word :

Surface/Interface Control, Decision of Precise Position/ Fabrication and Measurement, Nano/Precision Fabrication, Simulation Engineering, Nanoprecision/Micro Mechanical Fabrication, Desk-top Fabrication, Ultra Micro Fabrication/Fabrication Ultra Smooth Surface, Surface Modification Machining, ELID,

Outline

The main objective of our research is the development of revolutionary and new material processing technologies in grinding, lapping, polishing, cutting and forming for an extensive range of materials. Through advanced research activities on ultraprecision, ultrafine, nanoprecision and ultra-smooth machining processes, required for the fabrication of advanced functional devices such as optical and electronic components, we launched the research of a new field of micro-mechanical fabrication technologies in addition to surface functional modification, transcription process, feedback fabrication techniques, aiming at a wide variety of materials, precision, qualities, and scales ranging from micrometer to nanometer level, to meet advanced scientific, practical and applied industrial needs.

Research Subjects and Members of Materials Fabrication Laboratory

- 1 . Nanoprecision mechanical fabrication processes for micro-structural/functional devices
- 2 . Ultrafine transcription and computational mechanics assisted processes
- 3 . Applications on micro-fabrication processes
- 4 . Research on tribofabrication processes

Principal Investigator

大森 整 Hitoshi Ohmori

三上 誉人 Yoshito Mikami
峯村 拓 Taku Minemura***Research Staff***和田 智之 Satoshi Wada
片平 和俊 Kazutoshi Katahira
上原 嘉宏 Yoshihiro Uehara
水谷 正義 Masayoshi Mizutani
国村 伸祐 Shinsuke Kunimura
斎藤 徳人 Norihito Saitou
八須 洋輔 Yosuke Hachisu
春日 博 Hiroshi Kasuga
小川 貴代 Takayo Ogawa
小野 照子 Teruko Ono
湯本 正樹 Masaki Yumoto
島井 博行 Hiroyuki Shimai
根本 昭彦 Akihiko Nemoto
利根 直樹 Naoki Tone
金 允智 Yunji Kim
佐々木 慶子 Chikako Sasaki***Assistant and Part-timer***土屋 都紀子 Tokiko Tuchiya
中田 統子 Noriko Nakata
下田平 尚美 Naomi Shimodaira
南 ともみ Tomomi Minami
湯沢 由弥子 Yuyako Yuzawa***Visiting Members***Min Sangkee
梅津 信二郎 Shinjiro Umezu
林 偉民 Weimin Lin
成瀬 哲也 Tetsuya Naruse
山内 和人 Kazuhito Yamauchi
三村 秀和 Hidekazu Mimura
Allen Yi
江面 篤志 Atsushi Ezura***Students***前田 康大 Yasuhiro Maeda
大内 郁男 Naoki Ohuchi
鶴岡 直紀 Naoki Tsuruoka
濱田 美星 Mihishi Hamada
天野 有規 Amano Yuki
古川 瑞樹 Furukawa Mizuki
矢野 雄也 Yano Yuya
小倉 容幸 Ogura Yoshiyuki
本多 遼 Honda Ryo
秋山 寛郎 Akiyama Hiroo
小山 勝未 Katsumi Koyama
近藤 奨 Tsutomu Kondo
JUNG MYEONG - WON
田中 健一 Kenichi Tanaka